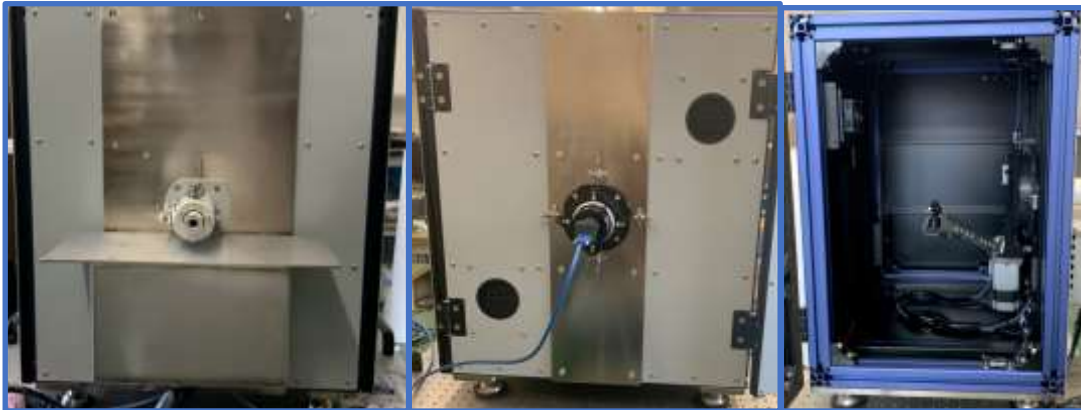


*μLED からKWレーザーまで、回転軸 360° × 摺動軸 180° 30 秒で測ります*

## メカニカル走査式 配光角度分布測定装置 LADA-200



### 概要

LADA-200 メカニカルスキャン配光分布測定装置は光センサーまたは光ファイバーを回転機構と揺動アームにより極座標走査させ、回転方向 360° × 摺動方向 ±90° の配光分布 (FFP) を測定します。測定時間は回転方向 10° 間隔の測定で最速約 30 秒です。

測定可能な波長域は標準仕様では可視域 350~1100nm 広帯域 500~1700nm です。センサーを選択することで遠紫外~可視~遠赤外更には電磁波領域まで対応できます。測定パワー、感度については μW から KW まで測定対象光源の用途に拠り装置構成が異なりますのでお問合せ下さい。

測定対象はファイバーレーザー、半導体レーザー、LED、OLED、Mini-LED、μLED 光源、回折型光学素子 (DOE)、レンズ等の光学部品、光学系の光線追跡などの他、光検出器の代わりに励起光源を光路中に配置してセンサーや太陽電池等の変換角度分布測定、化学試料、物質の蛍光、反射、散乱等の角度分布計測も可能です。測定角度範囲は 0.01° から 90° まで選択でき最小分解能は 0.002° です。更に試料の中心位置を調整する測定系をオプションで選択できます。

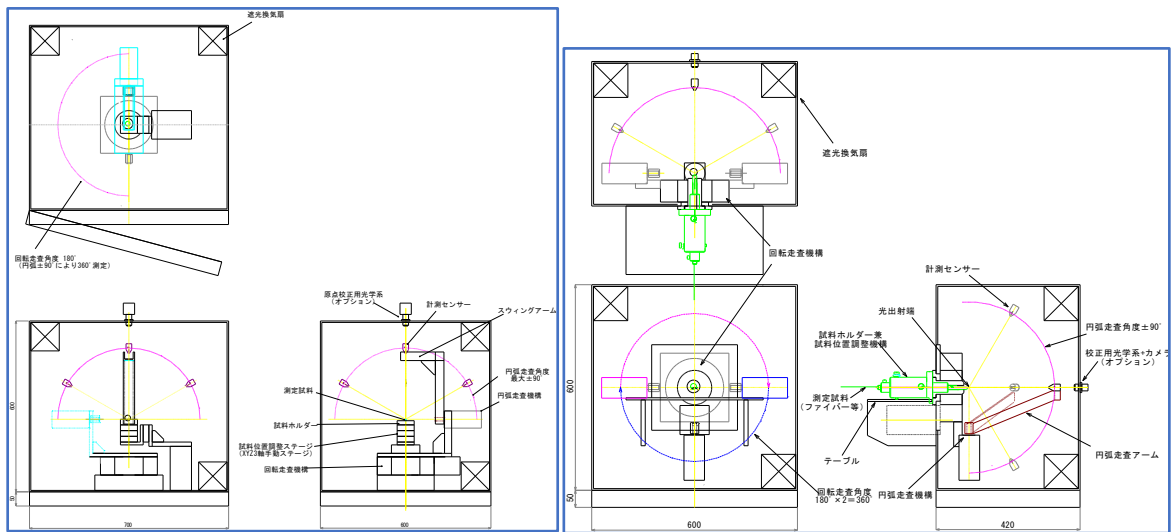
### ・特徴

- 1) メカニカル走査のため、回転軸 360° × 摺動軸 180° 最小角度分解能は 0.002° です
- 2) レンズを使わない方式により、図形歪みやノイズの少ない高精度測定が可能です
- 3) μW から KW クラスまで広範囲の測定に対応します
- 4) 発光面積の大きな発光体の配光分布の測定も可能です
- 5) 試料の出射端画像からゼロ点を検出し位置合わせする機能を追加しました
- 6) 用途により縦置きと水平置きタイプが選択できます
- 7) センサー部に光源をセットして走査することで試料の入射角度分布が測れます
- 8) 摺動半径が 25cm と大きく、背景光による影響の少ない計測が可能です
- 9) センサーの選択/交換だけで VUV から遠赤外、電波領域まで対応可能です
- 10) センサーの面積が大きくダイナミックレンジは 1 : 100,000 以上が可能です
- 11) 暗箱内壁は耐熱黒色塗装され、空冷ダクトは完全遮光により安全です
- 12) 測定時間は摺動スキャン幅 ±60°、回転走査 10° ステップ 測定時で約 30 秒と高速です

・用途

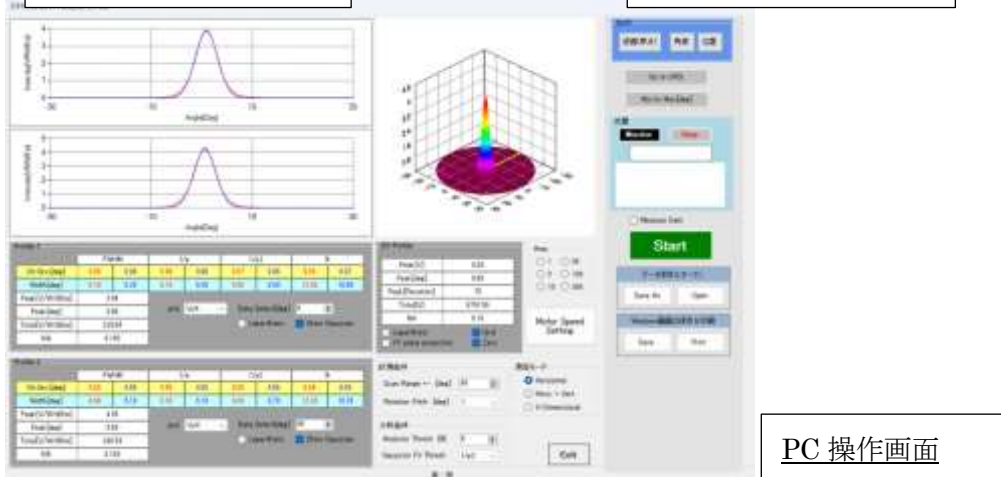
- 1) 半導体レーザ、LED の出射光角度分布測定
- 2) ファイバーレーザの出射端光学特性の測定
- 3) OLED、Mini-LED、 $\mu$ LED の出射光角度分布測定
- 4) 回折型光学素子 (DOE) の回折パターン解析
- 5) レンズ、光学部品の高精度光線追跡
- 6) 化学試料、物質の蛍光、反射、散乱の解析
- 7) センサー、太陽電池の受光角度分布測定

外観図 例



LADA-200V 縦置きタイプ

LADA-200H 横置きタイプ



**プレサイズゲージ株式会社**

販売代理店

〒433-8105 静岡県浜松市中央区三方原町283-4

tel:053-430-5023 fax:053-430-5024

E-mail:sales1@p-gauges.com

http://www.p-gauges.com

**PRECISE GAUGES**